# Лабораторная работа 4.3.3

# Исследование разрешающей способности микроскопа методом Аббе

Татаурова Юлия Романовна 29 марта 2025 г.

## Аннотация

В работе предлагается определить периоды сеток сначала по их спектру на удалённом экране, затем по увеличенному с помощью модели микроскопа изображению сеток на экране и, наконец, по результатам измерения разрешающей способности микроскопа, наблюдать явления саморепродукции, пространственной фильтрации и мультиплицирования.

## Цель работы

Определение дифракционного предела разрешения объектива микроскопа методом Аббе.

## Оборудование

Лазер, кассета с набором сеток разного периода, линзы, щель с микрометрическим винтом, оптический стол с набором рейтеров и крепёжных винтов, экран, линейка.

## Теоретическая часть

### Предел разрешения оптических систем

Всякая оптическая система, предназначенная для получения изображений, имеет конечный предел разрешения, обусловленный дифракцией световых волн. Разрешающая способность оптического прибора определяется минимальным расстоянием  $\ell_{\min}$  между двумя точками в пространстве предметов, которое прибор может разрешить. Критерий Рэлея устанавливает, что две точки считаются разрешёнными, если максимум дифракционной картины от одной точки совпадает с первым минимумом от другой.

### Разрешающая способность иммерсионного микроскопа

Для иммерсионного микроскопа (объект в среде с показателем преломления n) разрешающая способность при некогерентном освещении выражается формулой:

$$\ell_{\min} \approx \frac{0.61\lambda}{n\sin A},\tag{1}$$

где A — апертурный угол объектива,  $\lambda$  — длина волны света. Апертурный угол определяется как угол между оптической осью и лучом, направленным из центра объекта в край линзы (рис. 1).

## Дифракция на периодических структурах

При когерентном освещении периодической структуры (например, дифракционной решётки) условие возникновения главных максимумов имеет вид:

$$d\sin\theta_x = m_x\lambda, \quad d\sin\theta_y = m_y\lambda, \tag{2}$$

где d — период решётки,  $m_x, m_y$  — порядки дифракционных максимумов,  $\theta_x, \theta_y$  — углы дифракции в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для двумерной сетки (двух скрещённых решёток) дифракционная картина представляет собой матрицу максимумов (рис. 2).

### Формирование изображения в микроскопе

В фокальной плоскости объектива F формируется дифракционная картина Фраунгофера (первичное изображение). При установке диафрагмы, пропускающей определённые порядки дифракции  $(m=0,\pm 1)$ , в плоскости  $P_2$  формируется вторичное изображение. Например:

- Вертикальная щель пропускает максимумы  $m_x = 0$ , формируя изображение горизонтальных штрихов.
- Горизонтальная щель выделяет  $m_y = 0$ , воспроизводя вертикальные штрихи.

Это явление называется пространственной фильтрацией.

### Критерий разрешения для когерентного освещения

При уменьшении апертуры A волны нулевого порядка фокусируются на краю диафрагмы. Для разрешения необходимо, чтобы угол между волнами 0-го и 1-го порядков составлял 2u. Минимальное разрешаемое расстояние:

$$\ell_{\min} \approx \frac{\lambda}{\sin A} \approx \frac{\lambda}{D/2f},$$
(3)

где D — диаметр диафрагмы, f — фокусное расстояние объектива.

## Экспериментальная установка

#### Схема проекционного микроскопа

Установка включает:

- Лазер с коллимированным пучком, падающим на сетку C.
- Длиннофокусный объектив Л1  $(f \approx 10 \text{ см})$  для формирования первичного изображения в плоскости F.
- Короткофокусную линзу Л2, проецирующую изображение на экран.
- Кассету с сетками различного периода d.
- Щелевые и крисовые диафрагмы в плоскости F.

#### Методика измерений

#### 1. Калибровка сеток:

• По дифракции Фраунгофера: Измерение расстояния между максимумами на экране с последующим расчётом периода d по формуле:

$$d = \frac{\lambda f}{y},\tag{4}$$

где y — расстояние между максимумами.

• По увеличенному изображению: Прямое измерение периода через увеличение микроскопа.

2. **Определение разрешающей способности:** Подбор минимального размера щели в плоскости F, пропускающей максимумы  $m=0,\pm 1$ . Расчёт апертурного угла A по формуле:

$$\sin A = \frac{D}{2f},\tag{5}$$

где D — размер диафрагмы. Проверка соответствия с теорией через соотношение  $\ell_{\min} pprox \lambda/\sin A$ .

### 3. Пространственная фильтрация:

- Наклон щели позволяет получать изображение наклонной решётки.
- Перестановка сетки и щели вызывает мультипликацию изображения.

## Особенности установки

- Для безопасности исключено визуальное наблюдение через окуляр.
- Наличие непериодического объекта (проволочки) для идентификации геометрического изображения.
- Использование крисовой диафрагмы для изменения апертуры.
- ullet Возможность установки масок в плоскости F для демонстрации пространственной фильтрации.

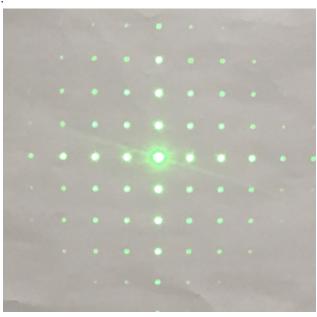
## Результаты измерений и обработка данных

### Определение периода решёток по их пространственному спектру

Соберём установку согласно описанию. Длина волны излучения лазера  $\lambda=532$  Расстояние от сетки до экрана  $H=100\pm 2$  см, погрешность объясняется неопределённостью положения сетки внутри кассеты, погрешностью меток на столе, использованных при измерении, и погрешностью прямого измерения. Измерим линейкой на экране расстояние  $\Delta x$  между n+1 максимумами и рассчитаем по второй формуле с учётом  $\varphi=\frac{\Delta x}{H}$  период решетки  $d=\frac{n\lambda}{\Delta x}H$ . Результаты приведены в Таблице 1.

Номер	$\Delta x$ , cm	n	d, MKM
решётки			
1	22.7	6	20
2	22.6	9	30
3	25.1	20	60
4	22.5	35	117
5	22.7	48	159

Таблица 1.



Дифракция Фраунгофера на двумерной решетке.

## Определение периода решёток по изображению, увеличенному с помощью модели микроскопа

Соберём модель микроскопа, добавив линзы согласно Рис. 1. Фокусные расстояния линз  $F_1 = \text{мм}, F_2 = \text{мм}.$ Измеряем необходимые расстояния:

$$a_1 = 120 \pm 10,$$
  
 $a_2 + b_1 = 455 \pm 10,$   
 $b_2 = 815 \pm 10,$ 

Погрешности здесь обусловлены неточностями в положения сеток и линз. Из формулы тонкой линзы  $a_2 = \frac{b_2 F_2}{b_2 - F_2} = 25.79$  к откуда  $a_2 \approx F_2$ , поэтому в дальнейшем будем использовать это значение, следовательно  $b_1 = 420 \pm 10$  мм.

Увеличение микроскопа  $\Gamma = \frac{b_1 b_2}{a_1 a_2} = 114 \pm 10.$ 

Повторим измерения периодов изображений в новой конфигурации, погрешности считаются аналогично. Измерение представлены в Таблице 2.

3десь d определялось по формуле  $d=\frac{\Delta x}{\Gamma_n}$ . Обратим внимание, что значения периодов решётки совпадают в пределах погрешности.

Номер	$\Delta x$ , см	n	d, mkm
решётки			
1	3.7	16	20
2	15.7	49	28
3	25.3	38	58
4	24.1	18	117
5	23.6	13	159

Таблица 2.



Увеличенное изображение сетки.

## Определение периода решёток по оценке разрешающей способности микроскопа

Поместим в фокальной плоскости линзы  $\Pi_1$  щелевую диафрагму с микрометрическим винтом и определим минимальную толщину D при которой на экране видна двумерная решётка. В этом случае период будет вычисляться по формуле (3) в предельном случае

$$d = \frac{2\lambda F_1}{D}$$

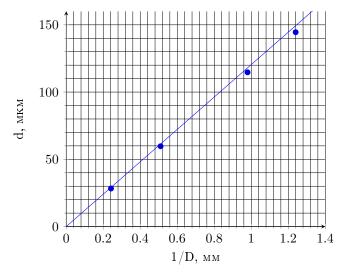
погрешность вычисляется по формуле

$$\sigma_d = d \frac{\sigma_D}{D}.$$

Результаты приведены в Таблице 3.

Номер решётки	D , мм	1/D, мм	d, MKM
1	=	_	=
2	4.14	0.242	28.3
3	1.96	0.510	59.7
4	1.02	0.980	114.7
5	0.81	1.240	144.5

Таблица 3.



Зависимость d = f(1/D).

Через щель проходили только нулевой (по центру) и два первых максимумы, за исключением второй щели, где нулевой максимум был помещён к краю щели. Для первой решётки период таким методом измерить не получилось, так как ширины щели не хватает.

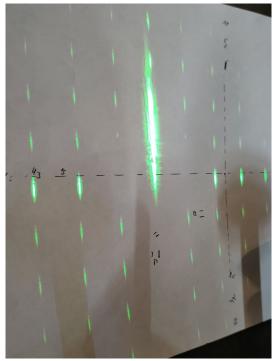
Для проверки теории Аббе построим график  $d=f\left(\frac{1}{D}\right)$  со значениями d из части 1, погрешность  $\frac{1}{D}$  рассчитывается по формуле

$$\sigma_{1/D} = \frac{\sigma_D}{D^2}$$

Угловой коэффициент прямой из МНК  $k=(124\pm8)\cdot10^{-9}{\rm M}^2$ , в пределах погрешности он совпадает с теоретическим  $2\lambda F_1=117\cdot10^{-9}{\rm M}^2$ . Таким образом, теория Аббе подтвердилась.

## Пространственная фильтрация и мультиплицирование

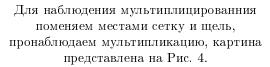
Для наблюдения фильтрации на сетке 2 откроем щель так, чтобы она пропускала только максимум нулевого порядка и, поворачивая щель, наблюдаем за изменением картины. Картины представлены на рисунках ниже.





Щель, повернутая на  $45^{\circ} (m_x = m_y)$ .

Горизонатальная щель  $(0, m_y)$ .



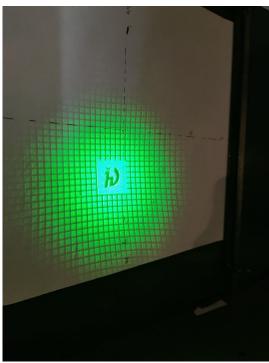


Схема для наблюдения интерфереционной картины.

# Вывод

По измерениям спектров определены дифракционные углы и по теоретическим формулам рассчитаны периоды решеток. Полученные данные сошлись с результатами, полученными по измерениям увеличенных с помощью микроскопа изображений сеток. Построен график зависимости d=f(1/D).

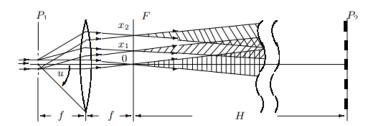


Рис. 1: Схема образования изображения в объективе микроскопа.

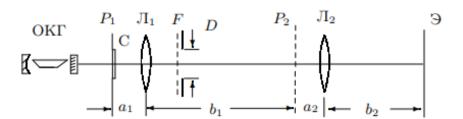


Рис. 2: Схема экспериментальной установки: 1 — лазер (ОКГ), 2 — сетка, 3 — объектив Л1, 4 — фокальная плоскость F, 5 — линза Л2, 6 — экран.